



Микроскопите на ZEISS.

Иновативни решения за визуален контрол, QA-QC и изследване на материали

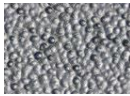
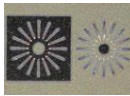


ZEISS Stemi. Рутинни стерео микроскопи



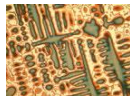
- Компактен рутинен стерео микроскоп
- Апохроматична оптика
- Zoom фактор: 5:1 и 8:1
- Увеличения от 1,9x до 250x
- Осветителни техники при отразена и преминаваща светлина
- Голямо видимо поле - до 122 мм
- Интегрирана Wi-Fi или външна камера

ZEISS SteREO Discovery. Индустринни стерео микроскопи



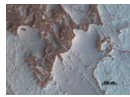
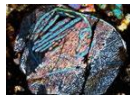
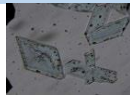
- Универсален стерео микроскоп
- Апохроматична оптика с най-висока разделителна способност 1000 LP/mm
- Zoom фактор: 8:1 / 12:1 / 20:1
- Увеличение - до 1312.5x
- Всички видове осветителни и контрастни техники, флуоресценция и поларизация
- Възможност за пълна моторизация и корелативна микроскопия с други микроскопи

ZEISS Primotech. Рутинни и учебни прави микроскопи



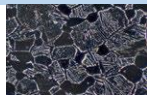
- Рутинен индустринен микроскоп за QA/QC, подходящ за учебни цели в технически дисциплини
- Кодиран револвер за 5 обектива
- Преминаваща и отразена светлина за поларизация
- Голямо работно разстояние (FWD) за проби - до 34мм
- Интегрирана Wi-Fi или външна камера

ZEISS Axio Score.A1. Модулни прави микроскопи



- Модулен прав микроскоп за изследване на материали в 23 различни конфигурации
- 6 обектива и възможност за работа при отразена и преминаваща светлина
- Всички контрастни техники: BF, DF, DIC, C-DIC, POL, FL, Ph, PlasDIC
- Голямо работно разстояние - до 560 мм
- Съвместимост с всички класове обективи на ZEISS

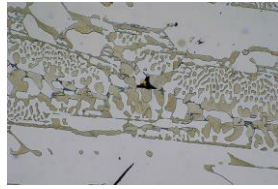
ZEISS Axio Vert.A1. Инверетен металографски микроскоп



- Инверетен металографски микроскоп за микроструктурен анализ на материали
- Кодиран револвер за 5 обектива
- Контрастни методи за всякакви структури
- Работна маса за поставяне на големи и тежки проби. Възможност за моторизирана маса
- Връзка с микроскопска камера със специализиран ZEISS софтуер за анализ на материали



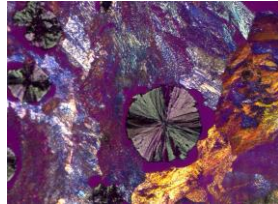
ZEISS Axio Imager 2. Изследователски прав микроскоп



- Най-висок клас изследователски прав микроскоп с възможност за пълна моторизация на всички компоненти
- Револвер за до 7 обектива
- Контрастни методи за всякакви структури
- 10 нм прецизност на Z-фокус и възможност за добавяне на конфокален модул
- Софтуер Shuttle&Find за корелативна микроскопия с електронен микроскоп



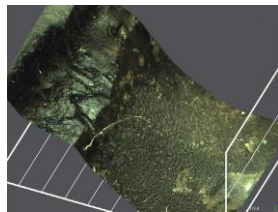
ZEISS Axio Observer. Изследователски инвертен микроскоп



- Най-висок клас изследователски инвертен микроскоп с възможност за моторизация на всички компоненти
- Револвер за до 6 обектива
- Контрастни методи за всякакви структури
- 10 нм прецизност на Z-фокус и възможност за добавяне на конфокален модул
- специализиран ZEISS софтуер за анализ на материали: NMI, Grains, Multiphase, Graphite, PA



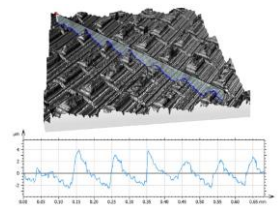
ZEISS Smartzoom 5. Дигитален микроскоп



- Моторизиран дигитален микроскоп за качествен контрол и бърз анализ на различни материали
- Максимално увеличение – 1011x и разделителна способност $\sim 1 \mu\text{m}$
- Интуитивно управление чрез сензорен екран
- 3D реконструкция на повърхнини
- Софтуер Shuttle&Find за корелативна микроскопия с електронен микроскоп



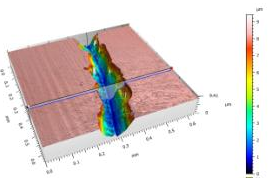
ZEISS Smartproof 5. Дигитален конфокален микроскоп



- Конфокален микроскоп за характеризиране на повърхности: топография, грапавост, прецизни измервания
- Интегриран ConfoMap софтуер за измерване на геометрични параметри и анализ на грапавост в 2D или 3D по ISO стандарти
- Интуитивно управление чрез сензорен екран
- Източник на светлина – 405 nm LED с конфокален диск за много бързо сканиране



ZEISS LSM 800. Лазерно сканиращ конфокален микроскоп



- Конфокалният лазерно сканиращ микроскоп обединява всички предимства на светлинен микроскоп Axio Imager.Z2m и конфокален модул LSM 800 (120 нм – резолюция и 3D)
- Възможност за работа с лазерни модули URGB (405, 488, 561, 640 nm)
- Сканиране в 1 или 2 канала с MA-PMT; GaAsP или Airyscan детектори



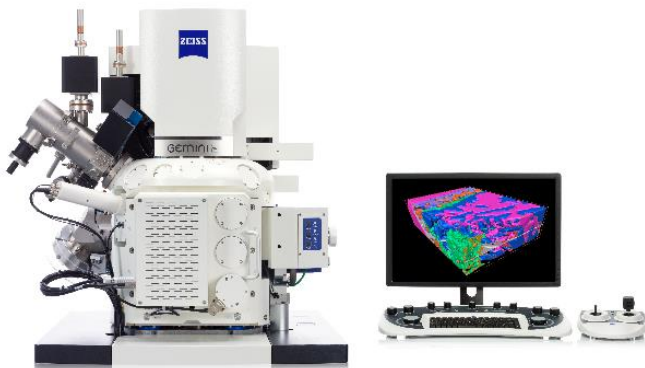
ZEISS EVO. CSEM

- Конвенционален сканиращ електронен микроскоп с W или LaB₆ източник
- 3 основни конфигурации според големината на камерата: EVO 10/15/25
- Увеличения <math>< 5 - 1,000,000\times</math>
- 2 nm, 3 nm @ 30 kV SE с LaB₆, W
- Работно налягане: 10 – 3000 Pa
- Оптимизиран работен процес в 4 стъпки
- До 11 порта за инсталиране на детектори
- EDS/WDS портове с най-добра аналитична работна дистанция 8.5mm / 35 градуса



ZEISS Merlin. FE-SEM

- Сканиращ електронен микроскоп с полева емисия и отлични аналитични възможности (12 – 2.000,000 x) / (0.8 nm @ 15 kV)
- Първокласна Gemini II оптика
- 15 порта за детектори и редица аналитични възможности
- Надграждане с 3DSM, AFM, Cryo, Raman, Plasma cleaner и много други
- Оптимална производителност при сложни аналитични експерименти с EDS/WDS/EBSD



ZEISS Crossbeam. FIB-SEM

- Crossbeam FIB-SEM за нанотомография и нанотехнологии в 2 основни модела 340/540
- Най-висок клас FE-SEM с GEMINI технология базирана на Merlin и Focused Ion Beam (FIB) за 3D нано моделиране, нанотехнологии, аблация, подготовка на образци и нанотомография
- 3D реконструкция – възможност за едновременно отнемане на материал и заснемане с различни детектори на FE-SEM
- Подходящ за *in situ* експерименти: опън, натиск, SIMS / CL, cryo или нагряване



ZEISS Xradia. 3D рентгенов микроскоп

- Рентгенов микроскоп 3D X-ray Synchrotron
- Безразрушително 3D възпроизвеждане на големи образци (до 300 mm/15 kg) чрез виртуални срезове
- Патентована оптична технология (Raad), която не се влияе от разстоянието между образец и източник за разлика от microCT
- Разделителна способност до <math>< 50\text{ nm}</math>
- Възможност за *in situ* експерименти: опън, натиск, влажност, cryo или нагряване